

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成 29 年 4 月 20 日 (2017.4.20)

【公開番号】特開 2016-8845 (P2016-8845A)

【公開日】平成 28 年 1 月 18 日 (2016.1.18)

【年通号数】公開・登録公報 2016-004

【出願番号】特願 2014-128270 (P2014-128270)

【国際特許分類】

G 0 1 N 29/04 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 29/10 5 0 2

【手続補正書】

【提出日】平成 29 年 3 月 8 日 (2017.3.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 3】

位置制御部 2 3 は、プローブ走査機構 5 に移動体 1 6 の移動指令を出力して移動体 1 6 を移動させるとともに、プローブ走査機構 5 から移動体 1 6 の移動量を入力しており、移動体 1 6 の位置を制御する。すなわち、プローブ 4 の位置を制御されている。また、プローブ 4 の位置毎に、上述した電子走査指令を遅延時間制御部 2 1 に出力するとともに、プローブ位置の情報をデータ収録部 2 2 に出力されている。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 8】

そこで、本実施形態では、計算機 7 は、接触状態判定部 2 5 及び接触状態制御部 2 6 を有している。接触状態判定部 2 5 は、同一のプローブ位置で取得された波形データのうちの一部を送受信部 6 のデータ収録部 2 2 から読み込み、これに基づき、シュー 1 1 の曲面 1 2 と配管 1 の外周面 1 3 との接触状態が良好であるか否かを判定する（詳細は後述）。そして、例えば接触状態が良好であると判定した場合に、判定材料である波形データを含む、同一のプローブ位置で取得された波形データを、データ記憶部 2 7 で最終的に保存させるようになっている。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 9】

一方、例えば接触状態が良好でないと判定した場合に、接触状態調整指令を出力する。接触状態制御部 2 6 は、この指令に応じて、プローブ走査機構 5 に支持軸 1 7 の回転指令を出力して支持軸 1 7 を回転させる。これにより、配管 1 の外周面 1 3 に対するプローブ 4 の傾きを調整して、シュー 1 1 の曲面 1 2 と配管 1 の外周面 1 3 との接触状態を調整する。その後、接触状態制御部 2 6 は、上述した電子走査指令を遅延時間制御部 2 1 に出力

する。すなわち、セクタ電子走査を再実行させるようになっている。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0041

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0041】

この場合、強度の差分 $|M2' - N2'|$ が所定の閾値より大きいから、シュー 11 の曲面 12 と配管 1 の外周面 13 との接触状態が良好でないと判定する。これにより、ステップ S106 の判定が満たされず、ステップ S108 に移る。ステップ S108 では、接触状態判定部 25 が、強度の差分 $|M2' - N2'|$ と強度 $M2'$ 、 $N2'$ の大小関係に応じて、接触状態調整指令を出力する。接触状態制御部 26 が、この指令に応じて、プローブ走査機構 5 に支持軸 17 の回転指令を出力して支持軸 17 を回転させる。これにより、配管 1 の外周面 13 に対するプローブ 4 の傾きを調整して、シュー 11 の曲面 12 と配管 1 の外周面 13 との接触状態を調整する。